# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-142087

(43)Date of publication of application: 17.06.1991

(51)Int.CI.

B23K 26/00

H05K 3/00 H05K 3/46

(21)Application number: 01-278353

(71)Applicant:

CANON INC

(22)Date of filing:

27.10.1989

(72)Inventor:

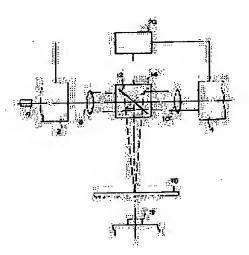
INAGAWA HIDEHO

NOUJIYOU SHIGENOBU

#### (54) METHOD FOR BORING PRINTED WIRING BOARD

(57)Abstract:

PURPOSE: To execute good boring by using two kinds of laser beams which vary in wavelength and changing processing conditions at the time of processing of a resin part and at the time of processing of a foil part when the wiring board imparted with conductive foil on the surface of the resin part is bored by the laser beams. CONSTITUTION: A command signal is emitted from a control command to an inversion driving device 14 so as to cause a mirror 12 to attain a 1st position when an irradiation command is emitted from a control device 20 to a laser 2. On the other hand, a command signal is emitted from the control device to the inversion driving device 14 so as to cause the mirror 12 to attain a 2nd position when the irradiation command is emitted from the control device 20 to a laser 4. The pulse transmission of a 1st laser light source and the pulse oscillation of a 2nd laser light source and the turning inversion operation of the mirrors are synchronized. The two laser beams make common use of the optical path from the mirror 12 to a printed circuit board 16. The optimum processing conditions are set by combining the high-speed processing and clear processing in this way, by which the good boring is executed.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平3-142087 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

@Int. Cl. 5 B 23 K H 05 K 26/00 3/00 3/46 識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)6月17日

330 K Y 7920-4E 6921-5E 7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

60発明の名称

プリント配線基板の穴明け加工方法

頭 平1-278353 ②特

頤 平1(1989)10月27日

- 311 稲 明 者 個発

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

重 信 明 者 能條 個発 キャノン株式会社 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑦出 願 弁理士 山下 穣平 10代 理 人

#### 1. 発明の名称

ブリント配線基板の穴明け加工方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 樹脂部の表面に導電性狢を付与してなるブ リント配線基板にレーザービームを照射して次明 け加工する方法において、波長の異なる2種類の レーザーピームを用い、上記樹脂都の加工時と上 記箔部の加工時とで加工条件を変えることを特徴 とする、プリント配線基板の穴明け加工方法。
- (2) 上記レーザー光源がパルス発振せしめられ る、請求項1に記載のプリント配稿基板の穴明け 加工方法.
- (3)上記樹脂部の加工時において長波長レー ザービームのパルス高及び/またはパルス幅を漸 次変化させる、讀求項2に記載のプリント配線基 板の大明け加工方法。
- (4) 上記2種類のレーザー光源のバルス発振を 回期させ同時に同一箇所を照射する、請求項2に 記載のプリント配線基板の穴明け加工方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明はレーザービームを用いてプリント配線 基板(以下、単に「ブリント板」と称する)を穴 明け加工する方法に関する。

### [従来の技術及び発明が解決しようとする課題]

従来、ブリント板において、両面間の導通をと るための導体膜が形成されるスルーホールは、た とえばドリルを用いる穴明けにより形成されてい る。このドリルによる欠明けは加工穴数の少ない 場合にはある程度の精度が得られるが、連続加工 すると加工中の発熱によりドリル切削性能の低下 及びドリル損傷を生じ、加工時間が畏くなり、穴 内盤面の表面粗さ精度も低下してくる。また、ド リル加工の場合、直径O. 1mm #程度以下のド リルは折損しやすく、加工の自動化が困難であ る。また、ドリル加工の場合、穴内塾園の相さが 粗くなりがちであるので、穴明け後のメッキ処理 の際に大内殻面に均一且つ十分な厚さの導体膜が 形成できないという騒点がある。

第6図は従来のドリルによる穴明け加工を説明 する図である。

第6図の(a)は加工前のブリント板30を示すものである。該ブリント板は、ガラスエポキシ絶縁層30Aの両面に網絡30B、30Cを張りつけたものである。

第6図の(b)に示される様に、ドリル32に よる穴明け加工で形成された穴の内壁面は、ラン ダムな凹凸や上下両面の関口位置のズレ(ドリル のシューティングによる)等が生じている。

そして、東6図の (c) に示される様に、上記ドリル加工の六の内壁面にメッキにより導体層34を形成すると、凹凸が激しいので、導体層34が均一に形成されない。

以上の様に、従来のドリル大明けは、機械的加工であるが故に、大怪が小さくなればなるほど、 次の様な問題が生じてくる。

(1) ドリル径が小さいため、ドリルの強度が低

行なうレーザー加工機が示されている。また、上記特開昭 6 2 - 2 5 4 1 1 7 号公報には、それぞれ独立のレーザー装置から発振される異なる種類のレーザー光を混合照射する装置が示されてい

本発明は、レーザービームを用いたプリント板の穴明け加工において高い加工精度及び迅速な加工速度の可能な加工特性の優れた穴明け加工方法を提供することを自的とするものである。

#### 【課題を解決するための手段】

本発明によれば、上記目的を違成するものとし て

樹脂即の表面に導電性箔を付与してなるブリント配線基板にレーザービームを照射して大明け加工する方法において、波及の異なる2種類のレーザービームを用い、上記樹脂部の加工時と上記箔節の加工時とで加工条件を変えることを特徴とする、ブリント配線基板の大明け加工方法、が提供される。

下し、折れやすくなり、寿命が短い。

(2) ドリル寿命を延ばすためには、加工送り速度を通くすることが必要であり、加工時間が長くなる。

(3) ドリルの直行性及び加工位置精度が十分と はいえない。

(4) 穴の内壁面の凹凸が、穴径に比し大きくなり、次工程の導体層形成の際に均一厚さが得られず、従って、各種の原因に基づき発生する応力によりクラックが発生したりして導電特性が劣化し、信頼性が損なわれやすい。

一方、従来、微小径の大明けを行なう方法として、レーザービームを用いる大明け加工方法が提案されている(たとえば、特勝昭58-2039 0号公報、特勝昭58-168489号公報、特開昭62-254117号公報、特開昭62-2 89390号公報参照)。

上記特階略62-289390号公報には、異なる被長のレーザービームを使用し、これらのビームを被加工物の同一場所に照射して、加工を

本発明方法においては、上記レーザー光源をパルス発振せしめることが可能であり、その場合、上記樹脂郎の加工時において長波長レーザービームのパルス高及び/またはパルス幅を漸次変化させることができる。

#### 【夹施例】

以下、本発明の実施例について図面を参照しながら期間する。

第1図は本発明方法の第1の実施例の行なわれる装置の振略構成を示す様式図である。

第1回において、2は第1のレーザー光源であり、4は第2のレーザー光源である。第1のレーザー光源である。第1のレーザー光源は短波及のエキシマレーザー(K r F : 被長1=248 n m)であり、パルス発振を行なう。第2のレーザー光源は長波及の炭酸ガスレーザー(波長1=10.6μm)であり、パルス発振を行なう。 設度酸ガスレーザーの代わりに Y A G レーザー(放長1=1.06μm)を用いてもよい。

6 は参照光源であり、He - Neレーザーを用いている。

8はレーザー光源2から照射されるレーザービームを集光するためのレンズであり、石英からなる。10はレーザー光源4から照射されるレーザービームを集光するためのレンズであり、 Zn Seからなる。 Zn Seの代わりに G a A s を用いてもよい。

上記3つのレーザー2、4、6及び2つの築光レンズ8、10の光軸は合致している。そして、設光軸上において、上記集光レンズ8、10の中間には、ミラー12が配置されており、該ミラーは反転駆動装置14により、第1図の紙面に垂直の軸のまわりに回動せしめられ、実線で示される第1の位置と破線で示される第2の位置とをとることができる。

16 は被加工物たるプリント板であり、たとえばガラスエボキシ網張り積層板(東芝ケミカル社 製TLC-W-551: D. 6 mm 厚)である。 該プリント板は不図示のX-Y移動チーブルによ

ザー光源のパルス発振とミラーの回動反転動作と が同期せしめられている。

以上の様に、本実施例では、ミラー12からブリント板16までの光路を2つのレーザービームが共用している。そして、該光路に垂直にブリント板16を配置することにより、極めて良好な垂直穴明けができる。

向、本実施例においては、プリント板16を装 着しない状態で、参照用レーザー6から照射した レーザービームをセンサ18で検出することによ り、レーザー及び光学系の位置調整を行なうこと ができる。

第2図は本実施例の穴明け加工を行なう際の、ブリント板18の断面図を示すものである。加工の進行にともない(a)から(d)へと状態変化する。ブリント板16はガラスエポキシ絶縁層(以下、単に「樹脂部」と称する)16Aの両面に類落16B、16Cを張りつけたものである。

第3図は本実施例におけるレーザー2、4のパ

り移動可能に保持されている。

18は 照光の検出センサである。

上記ミラー12が第1の位置にある時には、 レーザー2からのシーザービームは、集光レンズ 8により集光せしめられ、ミラー12により反射 せしめられてブリント板16の所定の加工位置に おいてスポット(たとえば100μm ◆)を形成 する。

20は上記レーザー2、4の発振及び上記ミラー反転駆動装置14の動作を制御するための制御装置である。

ルスタイミングの一側を示す図である。

先ず、上記第2図(a)の飼育部16Bの加工時には、第3図(a)に示される様に、エキシマレーザービーム2aのみが利用される。エキシマレーザービームは波長が短いため光子エネルギーが大きく、また飼育による吸収が良好であり、飼育部の加工に適している。

 穴が形成される。

この工程では、形成された穴が深くなるにつれて、レーザービームの透過率が低下するおそれがあるのでので、バルス高を次第に増加させてい

次に、上記第2図(c)の網箔部16Cの加工 時には、第3図(c)に示される様に、エキシマ レーザービーム2gのみが利用される。

そして、最後に、上記第2図(d)に示される 貫通穴が形成された後に、第3図(d)に示される 様に、穴内壁面の残留物を除去する仕上げ工程 としてエキシマレーザービーム2gの照射を行な う。

第3図に示される様に、本実施例においては、 2つのレーザービームは同時にはパルス出力され ず、各レーザービームのパルス発生時にはその レーザービームをプリント版16の加工位置へと 導く様にミラー12の位置が制御される。

第4図は本発明方法の第2の実施例の行なわれ

第5図は本実施例におけるレーザー2、4のパルスタイミングの一例を示す図である。第5図において、(a)~(d)は上記第3図におけると同様に、上記第2図(a)~(d)に対応している。

本実施例では、第5図に示される様に、(b)の樹脂部加工工程では、2種類のレーザービーム2 a、4 aを同時にプリント仮16に照射することができる。従って、本実施例によれば、樹脂部の加工効率がより向上する。

もちろん、本実施例においても上配第 1 実施例 と関様な効果が得られる。

本発明は、上記実施例以外に適宜の変更が可能である。

たとえば、樹脂部加工時において炭酸ガスレーザービームのパルス高を次第に増加させることに加えてパルス概を次第に減少させてもよい。 これは、樹脂部の加工時において加工の進行にともない熱が蓄積され、その影響で大径が大きくなるこ

る装置の概略構成を示す模式図である。本図において、上記第1図におけると同様の部材には同一の符号が付きれている。

本実施例では、ミラー12を反転駆動させることなく、固定配置としている。そして、該ミラーはレーザー2からのレーザービームのためのみと され、レーザー4からのレーザービームのために ミラー13が用いられている。

ミラー13は集光レンズ8からブリント板16 へと到る光路を遮ることなく固定配置されてーム。従って、レーザー4からのレーザービームは、集光レンズ10により集光せしめられてブリント板16 により気射せしめられてブリント板16 へと到る光路とは角度をもたブリント板16 へと到る光路とは角度をあたり、次月ント板16 へと対しての所望精度が追れる。数角度をは、大明け加工の所望精度が追れる。

とがあり、これを防止するために照射時間 (パルス幅)を漸次短くするのである。

また、プリント板の樹脂部の材質及び铬部の材質に応じて、加工速度及び/または加工精度を向上させる様に、各工程における各レーザービームの各パルスの高さ及び幅ならびにパルスの数、更には2種類のレーザービームの組合わせ様式を適宜設定することができる。

#### [発明の効果]

以上説明した様に、本発明方法によれば、被長の異なる2種類のレーザービームを用い樹脂部加工時と溶部加工時とで加工条件を適宜変え、長 及レーザーの高出力を利用した高速加工と 短波 長レーザーの高光子エネルギーを利用した クリア な加工とを必要に応じて最適の加工条件を設定でき、良好に 六明け加工を行なうことができる。

また、レーザービームをパルス化することにより、2種類のレーザービームがブリント版に入討

#### 特開平3-142087(5)

する部分の光路を共通化し、且つ極めて遠いサイクルで交互にレーザービームを使用することができ、これにより必要に応じて実質上両方のレーザービームを併用して良好な加工を行なうことができる。

#### 4. 図面の順単な説明

第1図は本発明方法の行なわれる装置の概略構 成を示す模式図である。

第2図は本発明の次明け加工を行なう際のブリント板の断面図を示すものである。

第3図は本発明方法におけるレーザーのパルス タイミングの一揆を示す図である。

第4回は本発明方法の行なわれる簽置の概略構 成を示す模式図である。

第5団は本発明方法におけるレーザーのバルス タイミングの一例を示す図である。

第6図は従来のドリルによる大明け加工を説明 する図である。 2. 4 … レーザー光源、 6 … 照光源.

8,10…集光レンズ、

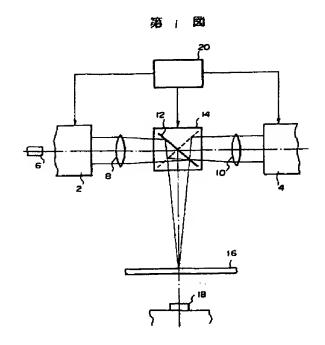
12, 13…ミラー、

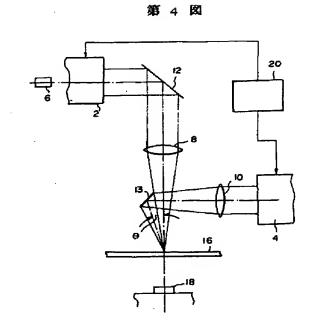
14…ミラー反転駆動装置、

16…ブリント板、

18…参照光検出センサ、 20…制御装置。

代理人 弁理士 山 下 粮 平





第 2 図

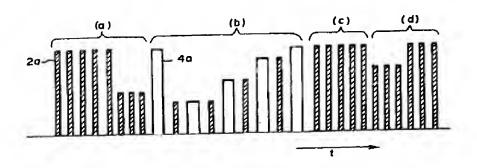
(a) (b) (c) (d)

16 8

16 A

16 C

第 3 図



第 6 図

